

試作コインランドリ 主要装置一覧



ドラフト(酸・有機)
~6"
フッ酸/硝酸/硫酸/塩酸等
有機洗浄/レジスト剥離等



真空オーブン
~6"
ヤマ科学 DP-31



ブラシスクラバ
~6"
全自動化
研産後のウェル洗浄用



スピンド乾燥機
4", 6"
SEMTOOL PSC101等3台
カセット式



LP-CVD
~6"
システムサービス
SiN, Poly-Si, NSG



熱CVD
~6"
国産電気
Epi-Poly Poly-Si, 1100°C



PE-CVD
~6"
日本産技術 VDS-5600
SiN, SiO₂



PE-CVD
~8"
住友精密 MPX-CVD
SiN(応力制御可), SiO₂



スピンド乾燥機
~6"
東邦化成 ZAA-4 2台
平置き式



イナートオープン
~6"
ヤマ科学 DN63H



UVキュア装置
~4"
ウシオ電機 ユニハード
UMA-802



ポリイミドキュア炉
~6"
ヤマ科学 DN43H



PE-CVD
~8"
住友精密 MPX-CVD
TEOS SiO₂



スパッタ装置
~8"
アネルバ SPF-730
8インチターゲット×3
AL, AlSi



スパッタ装置
~8"
至精マイクロテック CFS-4ESR
3インチターゲット×3
基板加熱1台, 基板冷却1台



スパッタ装置
~8"
至精マイクロテック Miller
3インチターゲット×4, 基板加熱形
ロードロック, 自動搬送付(10物まで)



パターンジェネレータ
~6"
日本精工 TZ-310
エマルジョン/ノマスク作製



レーザ描画装置
~6"
ハイデルベルグデザインシステム
DWL2000CE



スピコンタ
~6"
アクセス ASC-4000 2台
ミカサ 1H-DXII 2台



クリーンオープン
~6"
ヤマ科学 DE62 2台



W-CVD
~4"
アプライマテリアルズ
Precision 5000



電子ビーム蒸着装置
~6"
アネルバ EVC-1501



ゾルゲル自動成膜装置
~6"
テクノファイン PZ-604



MOCVD
~8"
ワコム研究所
PZT



EB描画装置
~6"
エリオニクス ELS-G12SS
Max130keV, 4nm



ステッパ
4", 6"
キヤノン FPA1550M4W
g線, 0.65μm



両面アライナー
~6"
Suss MA6/BA6 2台



スプレー現像装置
~6"
アクセス ADE-3000S
真空/メカチェック



高温スパッタ
8"
ユニテック 21-0604



ALD
~6"
テクノファイン ALK-600



ICP-RIE
~6"
ULVAC NE-550



CDE
~4"
芝浦エレクトロニクス CDE-7



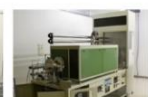
酸化・拡散炉
~6"
TEL XL-7
P形用, N形用それぞれ1台



中電流イオン注入装置
~6"
日新イオン機器 NH-20SR
200keV, 0.6mA



ランプアニール装置
~4"
AG Associates AG4100
100°C



メタル拡散炉
~6"
光研リソテック Model270
金属, 圧電基板等の熱拡散



Si Deep-RIE 4台
~8"
住友精密 MUC-21
SF₆, C₂F₄



ドライエッチング装置
~6"
アネルバ DEA-506
CF₄, CHF₃ (SiN, SiO₂用)



ドライエッチング装置
~4"
アネルバ L-507DL
SF₆ (Si用)



AI RIE
4"
芝浦エレクトロニクス HRRIE-100
Cl₂, BCl₃



アッシング装置
~6"
プランテック IPC4000
13.56MHz, 600W



プラズマクリーナー
~6"
ヤマ科学 POC210



サーフェイスプレーナー
~4", 8"
ディスク DAS8920



ウォーターレーザ
~6"
滝谷工業 LAMICS AQL-1900



多用途RIE
~8"
フルバック RH-1515Z
Cl₂, BCl₃, SF₆, CF₄, CHF₃, Al, Cu, Ni



ECRエッチング装置
3"
アネルバ ECR6001
Cl₂ (GaAs用)



Vapor HF
~6"
住友精密 Primax uEtch



KOH-TMAHエッチング槽
~6"
住友精密 Primax uEtch



ウェハ研磨装置
~6"
BNFテクノロジー
Bn52, Bn62



めっき装置
~6"
山本鍍金試験器
Au, Ni, Cu, Sn



ウェハ接合装置
~4"
Suss SB6e



ダイサ
~6"
ディスクDAD522, DAD2H6T
東京精密



イオンミリング装置
6" x 4枚, 4" x 6枚
エーエス/怡東
20BE-C



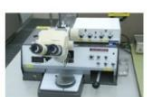
ウェハゴミ検査装置
~6"
トプコン WM-3



膜厚測定装置
~6"
Nanometric
NanoSpec 3000



段差測定装置
~6"
Dektak8
Tenchor AlphaStep 500



ワイヤボンダ
小片
West Bond (ほか)
Al/Au超音波, Al/Au熱圧着



コンベア炉
~4"
神港精機 FB-260HTE



レーザマーカ
~4"
GSIレモニクス WM-II



サンドブラスト
~6"
新東工業



深さ測定装置
~6"
ユニオン光学 Hisomet



4探針測定装置
~6"
Solid State Measurements
SSM150



拡がり抵抗測定装置
小片
オリンノス, 浜松トニクス



赤外線顕微鏡
~6"
オリンノス, 浜松トニクス



ウェハアライナー
8"
EVG Smart View



ウェハ接合装置
8"
EVG 520



ウェハ間樹脂封入装置
8"
EVG 520



UVインプリント
~4"
東芝機械 ST50



レーザ/白色光 共焦点
顕微鏡(表面形状測定)
~6"
レーザテック
OPTELICS HYBRID L3-SD



デジタル顕微鏡
~8"
キーエンス
クーネクテクトラフ



電子顕微鏡
~12"
日立 S3700N
熱電子SEM, EDX付属



電子顕微鏡
小片
日立 S5000
インレンズ型FE-SEM



熱インプリント
~50mm角
オリアン電気 Reprina-T50A
MAX 650°C, 30kN



TOF-SIMS
CAMECATOF-SIMS IV



FIB
小片
SII SM9200



大口径AFM
~8"
Digital Instruments
Dimension3100



エリプソメトリ
~6"
フォニックラテックス SE-101
ULVAC



マイクロX線CT
~6"
コムスキャンテック
Scanmate D160TS110



超音波顕微鏡
~12"
インサイト IS350



直線集束ビーム超音
波材料解析システム